

## 即時リリース

### 投資家向け広報窓口：

Ed Lockwood  
IR 部門シニアディレクター  
(408) 875-9529  
ed.lockwood@kla-tencor.com

### メディア向け広報窓口：

Meggan Powers  
コーポレートコミュニケーション部門シニアディレクター  
(408) 875-8733  
meggan.powers@kla-tencor.com

## KLA-Tencor が新しい Teron™ SL650 レチクル検査装置を発表

高い生産性と 193nm テクノロジーにより、  
20nm 以降のデザインノードでコスト効率のよい IC ファブのレチクルモニタを促進

カリフォルニア州ミルピタス発(2014年5月20日)。[KLA-Tencor Corporation](#) (NASDAQ: KLAC)は本日、20nm 以降のデザインノードに対応する、IC ファブ向けの新しいレチクル品質管理ソリューションである Teron™ SL650 を発表しました。193nm の照明と複数の STARlight™ 光学テクノロジーが組み込まれた Teron SL650 は、受け入れ検査、レチクルの劣化モニタ、パターンおよびオープン領域におけるヘイズの成長や汚染などの歩留まりに重大な影響を与えるレチクル欠陥の検出に必要な感度と柔軟性を実現します。さらに、Teron SL650 は業界屈指の量産スループットにより、高度なマルチパターンニングに必要な大量のレチクル管理のサイクルタイム短縮をサポートします。

「IC メーカーにとって、レチクル品質の変化は、転写されたすべてのウェーハに壊滅的な影響を与える可能性があるため、レチクルの状態を把握することは、パターン形成工程管理の中心的要素となります。弊社は IC ファブに適したコンパクトなプラットフォームに最先端のレチクル検査テクノロジーを導入し、次世代ノードに対応する最先端の感度、高い生産性、および拡張性を備えたレチクル品質管理システム、Teron SL650 を製品化しました。Teron SL650 で受け入れ検査をし、重大な欠陥のモニタ、量産時の進行性欠陥とマスクパターンの変化を特定することにより、半導体メーカーはデバイスの歩留まり、性能、およびサイクルタイムを維持できます。」と、KLA-Tencor のレチクル製品部門 (RAPID) 担当副社長兼本部長 Yalin Xiong 博士は述べています。

Teron SL650 は、STARlightSD™ と STARlightMD™ を使用してシングルダイおよびマルチダイなどさまざまなレチクルに対応し、優れた欠陥捕捉と包括的な検査領域を実現します。半導体メーカーは、画期的な STARlightMaps™ テクノロジーを使用して、長期間にわたってレチクルの劣化を追跡し、リソグラフィプロセスウィンドウやパターン形成に影響を与える可能性がある CD、膜厚、反射防止膜などの変化を特定することもできます。さらに、

Teron SL650 は EUV と互換性があるので、ファブ内の EUV レチクル検査要求に関して IC メーカーとの早期連携作業が可能です。

複数の Teron SL650 レチクル検査装置が世界中のファウンダリ、ロジック、およびメモリメーカーに設置されており、最先端 IC メーカーで使用されるレチクルの受入品質検査と再検査に使用されています。最先端の量産で要求される高い性能と生産性を維持するために、Teron SL650 検査装置は [KLA-Tencor のグローバルで包括的なサービスネットワーク](#) によって支えられています。Teron SL650 レチクル検査装置の詳細については、[RAPID IC ファブ シリーズ製品ページ](#) をご覧ください。

**KLA-Tencor について：**

KLA-Tencor Corporation は、プロセス制御および歩留まり管理ソリューションにおけるリーディングカンパニーであり、検査および計測装置の最先端技術をお届けするパートナーとして世界中のお客様に信頼されています。これらの技術は半導体、LED、その他の関連ナノエレクトロニクス業界で利用されています。業界標準の製品ポートフォリオと世界に誇る研究者チームによって、35 年以上にわたりお客様に優れたソリューションを提供してきました。KLA-Tencor は、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、世界中に販売およびサービス拠点があります。詳細については、<http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P) をご覧ください。

### 将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに記載されている過去の事例以外の事項、すなわち Teron SL650 レチクル検査装置に期待される性能、半導体業界における動向およびこれらに関連して予測される課題、KLA-Tencor の顧客により見込まれる Teron SL650 レチクル検査装置の用途、Teron SL650 レチクル検査装置が新しい機能に適合すると予測される拡張性、Teron SL650 レチクル検査装置の使用により実現可能な予想されるコストおよび運用上の利点およびその他の利点は将来の見通しであり、Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (1995 年私募証券訴訟改革法) の Safe Harbor (セーフハーバー) 条項が適用されます。これらの見通しは現時点での情報と予想によるものであり、多くのリスクと不確定要素を含んでいます。新技術の採用の遅延(コストまたは性能上の問題などの原因による)、競合他社による競合製品または代替技術の発売、当社製品の導入、性能、または使用に影響を及ぼす予期せぬ技術的な問題や限界など、さまざまな要因により、実際の結果はこれらの記述で予想された内容と著しく異なる場合があります。

###